

Изобретение относится к стекольной промышленности и может быть использовано при создании оборудования для литья изделий из стекла методом вакуумного всасывания.

Устройство для литья изделий из стекла методом вакуумного всасывания содержит смонтированную на держателе (1) форму (2) и расположенный коаксиально форме (2) поддон (3). В поддоне (3) выполнены каналы для охлаждения (4) и центральное отверстие, в котором закреплена всасывающая головка (6), которая соединена с вакуумной магистралью (7) и сообщается с глухими охлаждающими каналами и вакуумно-охлаждающими каналами (5), выполненными в поддоне (3), которые сообщаются, в свою очередь, с вакуумными каналами (8), сообщающимися с вакуумными каналами с меньшим размером (9). Каналы (8, 9) выполнены в форме (2). Вакуумно-охлаждающие каналы (5) снабжены каждый одним клапаном и сообщаются с каналами для охлаждения (4). В поддоне (3) выполнены аксиальные каналы (10), которые сообщаются с выполненными в форме (2) каналами для охлаждения (11). Количество глухих охлаждающих каналов и вакуумно-охлаждающих каналов (5) выбрано в зависимости от веса и конфигурации нижней части изделия (13).

П. формулы: 1

Фиг.: 3

